

V-4. 研究開発項目④ 高集積・複合 MEMS 知識データベースの整備

(マイクロマシンセンター)

1. 研究の概要

特徴

ネット上で自由記述・閲覧可能なシステムの構築

- 複数ユーザが特殊なアプリ、専門的記述言語の知識無く共同作業できる環境
- Web ブラウザ / MediaWiki システムを知識 DB のインフラとして活用
- Wiki(閲覧者の共同作業ツール)⇔ブログ(個人の情報交換ツール)



技術内容・特性

知識データの収集・体系化

- (プロセス、デバイス、材料特性、解析) 4分類を軸にファイン MEMS 研究・開発キーワードで知識データを体系化し、登録データ件数：1500 件超(目標 1000 件)
- 開発テーマに対応した 2000 年以降の国内公開特許、米国登録特許、および PCT 公開特許を調査し、抽出した 4500 件超をデータベースに実装
- 特許出願件数の多い MEMS / 半導体の一体形成技術および MEMS/MEMS の高集積結合技術の出願動向をまとめた分析資料集をデータベースに実装
- データベース傾向の可視化(カテゴリ・キーワード別知識ランキング表示)、今日の知識(日替わりランダム表示)、新着知識表示、各種検索機能(データベース内全文検索、Google 検索)



用途・目的

ファインMEMS開発・製造に係わる研究者・技術者の支援、裾野拡大を図ることを狙いとして、ファイン MEMS プロジェクトの一環として整備したファインMEMS知識データベースを、ウェブを通じてわが国産業界に広く公開するとともに、マイクロマシンセンター内のサーバーおよびユーザ登録の管理により、ユーザが関心を持っている技術分野・知識の把握・分析を行い、これらの情報を踏まえて、MEMS分野の包括的な知識基盤となる百科事典 MEMSPedia として整備、効果的な普及を図る。

2. 成果の詳細

②-1 高集積・複合MEMS製造技術に関わる知識データの収集、整理

高集積・複合MEMS製造技術に関わる知識、知見を集約するとともに、代表的なデバイス、プロセス、計測評価等関連技術について事例を含めて、知識データとして集約を行った。本開発事業の参画事業者（委託先及び助成先）の研究開発の成果（研究データや科学的知見）および再委託する大学の研究開発の成果に加え、国内外のMEMS関連の主要学会や主要学会誌（出版物）から知識データ情報を収集し、目標 1000 件に対して 1500 件超の知識データを収集し蓄積した。また、最新の知識データを収集した学会・シンポジウムは次の世界的主要学会をカバーした。

(1) Optical MEMS 2006 (International Conference On Optical MEMS and Their Applications, 2006年8月21日～24日、アメリカ) においては、特に光MEMSに関する高集積化関連技術の情報収集を主に行った。

(2) NNT2006 (Fifth International Conference on Nanoimprint and Nanoprint Technology, 2006年11月15日～17日、アメリカ) においては、ナノ構造或いはナノ修飾に関する製造技術の先端的な研究開発情報収集を主に行った。

(3) 2006IEDM (2006 IEEE International Electron Devices Meeting, 2006年12月10日～13日、アメリカ) においては、半導体集積化の中でのMEMS関連技術の知識データの収集を主に行った。

(4) Transducers 2007 (International Conference On Solid-state Sensors and Actuators and Microsystems, 2007年6月10日～14日、フランス) において、特にSensorやActuatorに関するMEMS高集積化関連技術の知識データの収集を主に行った。

(5) MNE2007 (33rd International Conference on Micro- and Nano-Engineering, 2007年9月23日～26日、デンマーク) においてマイクロ及びナノに関する機能の複合化関連技術の知識データの収集を主に行った。

(6) 2007IEDM (2007 IEEE International Electron Devices Meeting, 2006年12月10日～12日、アメリカ) においては、半導体集積化の中でのMEMSの高集積化関連技術の知識データの収集を主に行った。

(7) EUROSENSORS 2008 (22nd international conference EUROSENSORS, 2008年9月7日～10日、ドイツ) において、SensorやActuatorに関するMEMS高集積化関連技術及びパッケージング技術並びにアセンブル技術の知識データ収集を主に行った。

(8) MNE2008 (34rd International Conference on Micro- and Nano-Engineering, 2008年9月15日～18日、ギリシャ) においてマイクロ及びナノに関する機能の複合化関連技術の知識データの収集を主に行った。

また、高集積・複合MEMS製造技術に関わる特許情報として、①MEMS/ナノ機能の複合化技術、②MEMS/半導体の一体形成技術、③MEMS/MEMSの高集積結合技術の三つの研究開発項目を対象に、2000年以降2009年2月までに公開された国内（公開）、米国（登録）（国際特許PCT出願（公開）は、2000年以降2006年11月まで）の総件数12627件を、調査、分析し、ファインMEMSに係わる4500件超を分類・抽出してデータベースに実装した（表1、図4参照）。

さらに、ファインMEMSカテゴリの内、②MEMS/半導体の一体形成技術、③MEMS/MEMSの高集積結合技術（主にパッケージング関連技術）については、国内特許情報では表れてこない欧米企業・研究機関等の出願動向を調べるために、米国（登録）、欧州（EP公開）、国際PCT出願（公開）を対象に、分析し、主要な企業、研究機関の出願動向をまとめた総論部、及び代表的な特許情報の要約（和文）と特許フロントページを配置した各論部から成る分析資料集をデータベースに実装した。

表1 ファインMEMS関連特許分類一覧

ファインMEMS分類	国内公開特許	米国登録特許	PCT公開特許
A1: MEMS/ナノ機能の複合技術	204	10	2
A2: MEMS/半導体の一体形成技術	191	66	13
A3: MEMS/MEMSの高集積結合技術	66	32	2
A4: その他*	3968	20	—
抽出合計	4429	128	17

* A4（その他）は、A1～A3への分類困難であるが、ファインMEMSに関連する特許

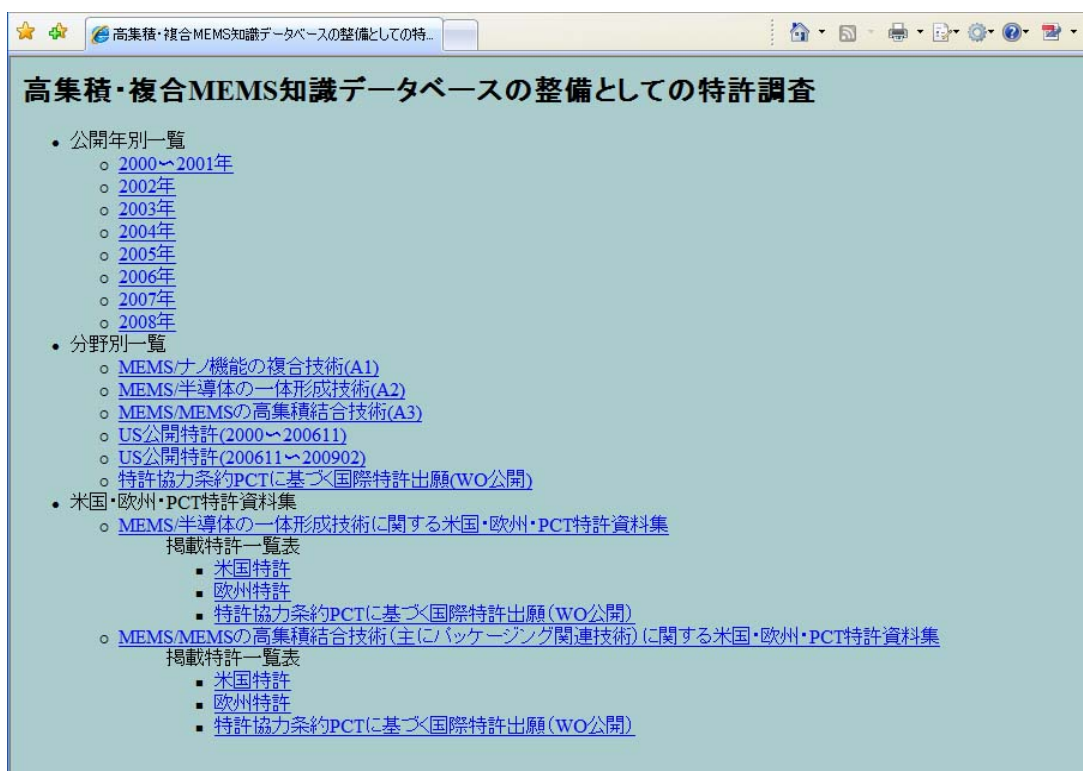


図4 知識データベースに実装した特許調査・分析資料の一覧

②-2 知識データの研究開発

助成（企業）対象の研究内容に関する知識データの収集を補完するため、MMCから大学研究室へ以下の研究開発を再委託することにより、それらの成果としての知識データを収集、整理した。

（1）MEMS／半導体におけるプロセス統合モノリシック技術に関する知識データベースの研究開発（東京大学 杉山研究室）

目的）CMOS デバイスとMEMSを1チップに集積させ新機能を発現するモノリシック集積技術は、次世代MEMSを設計するためにきわめて重要である。これには、エッチング、精密アラインメント、薄膜堆積による高アスペクト構造の埋め込み、平坦化など様々な要素技術が含まれている。しかもLSI製造技術と違ってこれらの要素技術が標準化されていない。そこで、すでに製作されているモノリシック集積MEMSに関する知見、今後MEMSに利用可能な新技術（たとえば超臨界製膜技術など）に関する知見を文献・学会発表などのデータから抽出し、知識データベースに入力した。

研究開発の成果）平成18年度は、プロセス統合モノリシックに関する項目を中心に31件のデータを入力した。とくに、「マイクロゼオライトカラムによるガス分離」、「O₂プラズマ処理を用いたInP基板とSi基板の接合」など異種材料の融合による高機能化に関連した事例を多く取り上げた。この中には、「マイクロチャネルエピタキシーによるヘテロエピタキ

シャル層の転位低減」など当研究室の成果を平易にまとめたものも含まれる。

平成19年度は、「シングルウォールカーボンナノチューブ(SWNTs)を用いた NO₂ ガスセンサ」など異種材料融合プロセスに関する事例をさらに入力するとともに、「水素化アモルファスシリコンを用いた高電圧太陽電池アレイ」、「光発電による静電アクチュエータの直接駆動」など太陽光発電の MEMS への取り込みに関する事例を、今後の展開が期待される分野として取り上げた。また、「超臨界 CO₂ を媒体に用いた金属製膜」、「超臨界 CO₂ を用いたガラス表面への生態適合材料のコーティング」など当研究室で開発したプロセス技術で、モノリシック集積 MEMS に関連の深い技術を平易にまとめて事例として入力した（平成19年度の知識データの登録件数 30 件）。

平成20年度は、「CMOS 上マイクロ流路での磁性体微粒子の操作と光学検出」、「リコンフィギュラブル IC に向けた CMOSMEMS プローブの作製」など、CMOS とマイクロ分析デバイスや MEMS との集積に関する事例、「CMOS プロセスによるシリコンナノワイヤアレイの作製」など CMOS プロセスを用いて MEMS に応用可能な機能構造を作製する事例を中心に、30 件を入力した。また、すでに入力されたデータベース内の事例を改良するためのコメントを 50 件入力した。

このような事例入力と並行して、データベースの内容をプロセスで実証するための実験を行った。LSI と MEMS の統合プロセスに不可欠なシリコンの深掘りエッチングに関して、超高真空蒸着装置を立ち上げ、アルミをマスクとした高アスペクト比のエッチングを可能にした。さらに、等方性エッチングと異方性エッチングのバランスによる 3 次元形状形成を支配するメカニズムを明らかにするための系統的な実験を行い、解析モデルとの比較検討によりエッチング形状を大枠で予測するモデルを構築した。

このような深掘りエッチング技術を活用した MEMS の作製にシミュレーションがどこまで精度よく活用できるかを検証するため、MemsONE および市販の汎用有限要素法シミュレーションソフト（COMSOL）を用いた櫛歯型振動子の設計を行い、設計に基づいて製作した振動子の機械特性を測定した。シミュレーション結果と実験結果の比較により、MemsONE におけるメッシュ生成の問題などを指摘し、シミュレーションの改善に貢献した。

（2）高集積化 MEMS 解析手法に関する知識データベースの研究開発

（東京大学 藤田研究室）

目的) 平成18年度～20年度にかけて、高集積化 MEMS 解析手法に関する知識データベースの研究開発を行った。平成18年度は、高集積化 MEMS 解析手法としてマイクロアクチュエータとそれを支持する機構を解析した。平成19年度は、電子回路とマイクロ機構が集積化されたデバイスに着目し、その動作解析手法を調査した。また平成20年度は、「生物を駆動源としたマイクロシステム」、「空気圧駆動マイクロバルブ」の内容を中心に、知識データベースに新規登録を行うとともに、データベースの質的向上を目指し、一二年次に作成したデータベースの内容に加筆を行った。

研究開発の成果)平成18年度は、高集積化 MEMS 解析手法としてマイクロアクチュエータとそれを支持する機構の解析を中心に研究した。

まず、多数のマイクロアクチュエータと複雑な支持構造が組み合わされた高集積 MEMS 駆動デバイスの典型例として、MEMS 機械式アナログ・デジタル (AD) 変換デバイスを取り上げ、その構造の概要、駆動原理、AD 変換原理を考案した。

そして本デバイスの最適な設計を行うため、連成バネ構造を弾性マトリックスで表現し、複数のマイクロアクチュエータからの駆動入力に対してどのような動きをするかを解析した。その結果に基づき、12ビットの機械式 AD 変換デバイスとして適切な動作をするように、総計60以上の支持バネの硬さを決定することができた。この結果を、知識データベースに登録した。

このデバイスは、静電駆動櫛歯型アクチュエータを用いているため、このアクチュエータの基本特性の解析についても検討し、その結果を知識データベースに登録した。すなわち、櫛歯アクチュエータの不安定性の解析手法、安定性を向上しより大きな変位を得るための支持構造の設計手法、位置決め用垂直くし歯型アクチュエータのクロストークを低減するための電極構造解析手法、静電アクチュエータの共振周波数と最大変位を規定する式の導出方法、などを調査した。

次にナノ構造デバイスとして、ウェットエッチングによるシリコン対向ナノ針端の製作方法、ナノ針端をシリコン電界電子放出銃として用いたときの先端の劣化状態を透過電子顕微鏡内で実時間観察した研究結果、生体分子モータをマイクロ流体デバイスに付加し標的分子を選択的に直接搬送するデバイスなどについて知識データベースに登録した。さらに、アクチュエータアレイチップとセンサアレイチップの積層集積化方法を含め、全部で10件に登録した。

平成19年度は、高集積化 MEMS の解析手法を検討するため、多くの電子回路とマイクロ機構が集積化されたデバイスに着目し、その動作解析手法を調査した。

解析ソフトウェアを用いて、センサとアクチュエータを集積したデバイスの動作解析を行った。そして実験結果との対比による解析の有効性の検討を試みた。これを高集積化 MEMS のデータベースへ追加した。またデータベースへ新規のキーワードなどを追加した。さらに文献検索によりデータを蓄積した。加えて、MEMS-08 (米国) に出席し、関連情報を収集した。以上の結果、知識データ累積登録件数は61件であった。

平成20年度は、高集積化 MEMS 解析手法に関する知識データベースを充実させるために、以下の3つの活動を行った。

他ユーザが登録した項目に対して、より内容の詳細が必要だと思う部分に、計52件のコメントを記入した。(データベース、ノートへの52件のコメント記入)

「生物を駆動源としたマイクロシステム」、「空気圧駆動マイクロバルブ」の内容を中心に、知識データベースに新規登録を行った。また第25回「センサ・マイクロマシンと応用システム」シンポジウムに出席し、情報を収集し、この情報についても登録を行った。(知

識データ累積登録件数：93 [61+32]件[2009年3月2日現在]

さらにノートに記載された21のコメントに対し、対応を行った。具体的には、データベースの項目に図表、説明、リンクの追加を行い、データベースの内容を充実させた(データベース、21件コメントへの対応)。

(3) MEMS/半導体における高集積配線技術のための知識データベースの研究開発

(東京大学 三田研究室)

目的) MEMSに先端CMOS回路を集積化することで、寄生素子の低減による性能向上や、機械部品が主体であったMEMS単体では不可能であった、高度なその場情報処理等新機能が創出されると期待できる。この、CMOS-MEMS集積化技術の鍵となる技術はCMOS回路とMEMSとの間を接続する「微細配線技術」である。わが国をはじめ欧米、アジア等で集積化MEMSの実現方法が提案されているが、これらの成果をひとつのデータベースにまとめることで技術の利用価値を向上させるものである。

研究開発の成果) 論文調査、MEMS集積化技術を研究している諸外国の研究機関の技術者と面会、国際会議等に出席、等の方法で、様々な研究機関で発表されている異種部品融合・微細配線技術のサーベイを行い、統一した形式でデータベース化した。また、CMOSポストプロセスを実際に行っている研究所・企業において実地調査(研究代表者自らの手によるプロセス実行も含む)を行い、成果をデータベース化した。このような研究を行い、生のラボデータを記入することによって論文では得られない<<現場>>の知見をデータベース化することができた。特に、研究代表者自らが全てのデータベース並びにコメントの記入を行うことで、質の高いデータベースの実現に寄与できたと考えている。

平成18年度は、シリコンMEMS構造を利用した立体配線技術、機械的にMEMS構造とLSIとの位置合わせを取る技術について、重要と思われる技術を東京大学武田先端知ビルにおいて追試し、得られた内容を元に使いやすいデータベース整備を行った。また、CMOS8インチラインをもち、ポストプロセスを専門とするエジンバラ大マイクロエレクトロニクスセンターに出張し、配線技術に関する情報収集を行った。同大学はスコットランドにおけるR&Dセンターの中心として最近新築されたクリーンルームを持ち、CMOSイメージセンサ発祥の地であるなど、イメージセンサやCMOS回路についての欧州における重要な拠点のひとつである。学会はNanotech Montreux 2006、MEMS2007に出席し動向調査を行った。

平成19年度は、前年度に引き続いて実地調査先として、エジンバラ大マイクロエレクトロニクスセンターを選び、第一・第二四半期に同大学に研究代表者自らが長期出張を行った。ここではポストプロセスによる配線技術とその応用をサーベイ・追試・開発した。生まれた成果を平成20年3月の国際会議 International Conference on Microelectronic Test Structure (ICMTS 2009, Edinburgh)で発表し、内容を速やかにデータベース化した。また、学会のチュートリアルから抜粋してデータベースを充実させた。学会ならびに研究

会として同年度に始まった「ナノテクノロジー・ネットワーク」への会合に出席して技術動向を調査、MEMS2008に研究代表者が出席して動向調査を行った。また本研究開発の予算によって Transducers2007 に出席し、引き続いて LETI/CEA、LAAS/CNRS、IEF/CNRS を訪問して先端 CMOS と MEMS の微細配線に利用可能な技術調査を行った。特に CEA-LETI 訪問が契機となって、技術主任の Jean-Philippe Gouy 氏の紹介によって、厚み 2.5 ミクロンの塗布が可能な電子線レジスト「OEBR-CAP112」を東京大学で継続的に購入するチャンネル開拓に成功し、MEMS 微細配線実験の実施がさらに容易になった。また、東京大学武田先端知ビルのスーパークリーンルーム環境は文部科学省の「ナノテクノロジー・ネットワーク東京大学拠点」を通じて全国の研究所・企業に技術提供ができるため、本邦の MEMS 微細配線技術の加速的な向上に寄与できることになった。

平成 20 年度は、引き続き文献調査、MEMS 集積化技術を研究している諸外国の研究機関の技術者と面会、国際会議等に出席、等の方法で、様々な研究機関で発表されている異種部品融合・微細配線技術のサーベイを行い、統一した形式でデータベース化した。ICMTS 論文会議、APCOT2008、ESSDERC2009、LATW などの国際学会への出席による情報収集に加えて、CMOS ポストプロセスを実際に行っている研究所・企業、またはアプリケーションとして MEMS を利用する研究所において動向調査を行い、成果をデータベース化した。

(4) MEMS/MEMS における多層接合技術のための知識データベースの研究開発

(東京大学 須賀研究室)

目的) 本研究は、接合技術に関するデータベース構造化を検討し、データベースの枠組みを構築することを目的とし、接合に関する知識を体系に整理し、高集積化 MEMS との関連をキーワードベースに相関させるものである。特に、当研究グループが中心になって行ってきた、MEMS 関連の低温接合技術研究の 900 余りの論文、および、特許検索等に基づいて、データベースのコンテンツを収集、分析し、さらにまた、ウエハの低温貼合せなどの重要技術については、実験的な検証実験を行い、独自の実験データ収集を行なうことを目的とした。

研究開発の成果) この目的を遂行するため、高集積・複合 MEMS 知識データのうち、特に、接合やウエハ貼合せのプロセス、構造、応用に関わるものに関しての検討を行なった。特に、平成 18 年度については、Wafer Bonding 国際会議への出席、および Polymer パッケージの国際会議の主催により、接合界面に被接合体とは異なる接合介在物質を挿入する方法と直接接合の 2 つの接合方法について、平成 19 年度においては、IEEE-CPMT の低温ウエハ接合国際会議の主催、平成 20 年度には ECS-Wafer Bonding Symposium のアレンジ等を通して、最新のウエハ接合に関する論文、科学技術的知見の蓄積・整理を行った。また、接合技術に関するデータベース構造化を検討し、ローカルなデータベースの枠組みを構築した。当研究グループが中心になって行ってきた、MEMS 関連の低温接合技術研究の 900 余

りの論文に基づき、接合に関する知識を体系に整理し、データベースのコンテンツを収集、分析した。特に表面活性化技術、表面改質技術、それらの応用事例を重点課題として、重要と思われる96件、ノート50件を、ファインMEMS知識データベースにアップした。

また、重要技術であるウエハの低温貼合せについては、シーケンシャルプラズマの効果に関する実験、高精度の位置決め、およびフッ素を使った新しい表面活性化手法の実験的検討等に関する実験的な検証実験を行い、Si やガラスに対して、低温接合のための新しい知見を得た。またこれらの実験や調査により収集したデータについても精査した上で本知識データベースに掲載した。

(5) MEMS-MEMS 結合技術のための知識データベースの構築

(慶応義塾大学 三木研究室)

目的) 高集積・複合MEMSの開発者のためのデータベース整備として、知識情報および学会等の新規技術情報の収集・体系化をおこなった。特に、本研究開発では、MEMSの高集積化、複合化に不可欠なMEMS-MEMS結合技術に関する知識データベースの構築をおこなった。

研究開発の成果) 平成18年度は、アクティブ方式およびパッシブ方式によるMEMSウエハもしくはチップの高精度な位置合わせ方法、デバイスの保護かつ異種材料の熱膨張係数の違いを考慮した接合後プロセスフローなど、ビルドアップ多層集積、チップレベル高精度接合に関し、国内外の最新の研究について、11月に米国バークレーで開催されたPowerMEMS2006、および1月にタイ国バンコクで開催されたIEEE NEMS、その他国内会議や、ジャーナル、書籍より情報収集をおこない、知識データベースに入力した。また、研究室において当該分野における基礎実験をおこなうために、備品として、ミスアライメント測定アライナ(特殊試料ホルダー:ユニオン光学)、高圧電源(HJPZ-0.3Px3:松定プレジジョン)、金属薄膜成膜装置(SC-701 Quick Coater:サンヨー電子)を購入した。シリコンウエハなど材料を購入し、基礎実験を開始した。入力知識データ実績30件を達成した。

平成19年度は、平成18年度に続き、アクティブ方式およびパッシブ方式によるMEMSウエハもしくはチップの高精度な位置合わせ方法、デバイスの保護かつ異種材料の熱膨張係数の違いを考慮した接合後プロセスフローに加え、液体の封入接合技術を含むビルドアップ多層集積、チップレベル高精度接合技術、さらにはポストボンディングプロセスに関し、国内外の最新の研究について、1月に米国アリゾナで開催されたMEMS2008、その他国内会議や、ジャーナル、書籍より情報収集をおこない、知識データベースに入力した。また、研究室において当該分野において基礎実験をおこなうために、備品として電気炉を購入した。シリコンウエハなど材料を購入し、液体封入接合技術およびパッシブアライメントに関する基礎実験を行った。入力知識データ実績30件を達成した。

平成20年度は、MEMSの高集積化、複合化に不可欠なMEMS-MEMS結合技術に加

え、ファイン MEMS 分野に大きく貢献すると考えられるナノ構造製作技術に関する知識データベースの構築を行った。特に、金、銀ナノ粒子の製作方法と、それを用いた接合方法、インクジェットや液相反応を利用したナノ構造製作に関する国内外の最新の研究について、2008年6月に台湾で開催された APCOT 2008、2009年1月にイタリアソレントで開催された MEMS2009、その他国内会議や、ジャーナル、書籍より情報収集をおこない、知識データベースに入力した。また、シリコンウエハなど材料を購入し、液体封入接合技術およびパッシブアライメントに関する基礎実験を行い、その成果を国際学会 MEMS2009 にて発表した。断面積が上部と下部で異なる（下部の断面積が上部より大きいとする）マイクロチャンバ内に、非圧縮性かつ不揮発性流体であるグリセリンを、大変形可能なシリコンゴムで封入した。接着剤には紫外線硬化樹脂を用いている。下部をマイクロアクチュエータで駆動すると、上部では、断面積の比に従い、変位が増幅されて出力される。この変位増幅機構を用いることで、触覚ディスプレイや、大流量バルブなど大変位を必要とするアプリケーションに使用可能な MEMS アクチュエータが実現される。特に、グリセリンを空気の混入なく封入するために、液体で封入する技術を確立した。通常のボンドアライナが使用できない液中接合のために、シリコンゴムの凹凸形状を利用したパッシブなアライメント技術を構築した。入力知識データ実績 30 件を達成した。また、知識データベースの質向上のために、他知識データベースに対し、ノート記入実績 50 件を達成した。

以上、平成 18～20 年度において、MEMS-MEMS 結合技術に関する基礎研究を行うとともに、国内外の学会および論文誌を調査し、90 件の知識データをデータベースに入力した。また知識データベースのあり方、内容について検討し、初心者への参考となる知識を共有化するための知識データベースの実現に貢献した。また、研究発表や、講演、および展示会での発表を通じ、当該研究とともに、高集積・複合 MEMS に関し収集・体系化された知識データベースの紹介を行い、その普及に貢献した。

②-3 高集積・複合 MEMS（ファイン MEMS）知識データベースの構築

本研究開発では、ファイン MEMS プロジェクトの研究開発を通じて得られた成果・知識情報、国際会議情報等を体系的にデータベース化し、高集積・複合 MEMS 開発・製造を目指す研究者・技術者が容易に活用できる環境を提供することを目的とした。そこで、知識データベースのユーザが、特殊なアプリケーションや専門的記述言語の知識が無くともデータの閲覧・登録を容易に行え、かつ継続的な知識データの編集・更新も簡単で、複数のユーザが同時に共同作業できる環境の構築に取り組んだ。この環境を実現するインフラとして、フリー百科事典「ウィキペディア」が活用例として知られている Web ブラウザ/MediaWiki システムの導入を行った。インターネットに接続可能な環境であれば、同時に複数のユーザが、気軽にいつでもデータを閲覧・更新・意見交換できることが、この Wiki システムの大きな特徴である。図 5 に示すように、本研究開発で

は、Web ブラウザ/MediaWiki システムをデータ蓄積サーバ（MMC内）に実装し、さらに知識データの体系的格納を可能に、かつ支援できるデータベースのシステム、入力・表示・検索機能を開発することで、知識データの蓄積及びデータベースシステムの構築を行った。

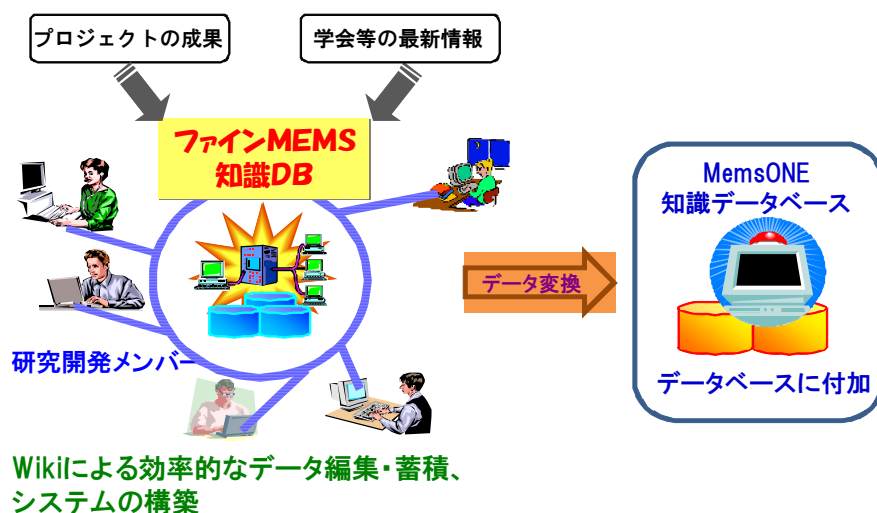


図5 ネット上での共同作業を主眼とする共有コラボレーション環境の構築

まず、平成18年度では、ファインMEMSに関する知識の体系化、データベースの枠組み、知識データの入力方式及び表示方式の設計等に関わる知識データベースの概念設計ならびに入出力方式等に係る技術的評価を踏まえた詳細設計の一部を実施し、知識データ収集用システムの構築と試験的な運用を実施した。さらに、平成19年度では、ファインMEMS知識データベースの詳細設計を完了し、知識データの集積およびシステムの構築作業を行った。また、データベース検索プログラムの開発および特許情報のデータベース化を実施した。そして、平成20年度では、ファインMEMSプロジェクト成果・知識情報の集積、登録データの質的向上を図りながら、知識データベースのWeb上の一般公開に向けたガイドラインの作成および一般公開用システムの構築作業を行った。また、高集積・複合MEMS知識データベースをMemsONE知識データベースへ付加することを目的としたデータ変換作業を実施した。

(1) 知識の体系化

知識の体系化として、ファインMEMSプロジェクトの研究開発項目から研究キーワードを抽出、整理を行い、表2のようなカテゴリに分類し、これをMediaWiki上でのデータ入力時の選択項目としてシステムに実装した。

一方、MemsONEは、4つの大分類項目（プロセス、デバイス、材料特性、解析）と、さらにそれぞれが中分類に細分化されたカテゴリで体系化されている。ファインMEMSの知識データをMemsONEの知識データに変換するために、カテゴリ分類の対応関係の明

確化を行った。その結果を表3に示す。

表2 ファインMEMS知識データベースにおける知識データのカテゴリ

- ・ ナノ機械構造
- ・ 選択的バイオ修飾
- ・ 選択的材料修飾
- ・ ナノ機能デバイス化
- ・ プロセス統合モノシリック
- ・ センサ新原理
- ・ CMOS/MEMS 多層
- ・ 3次元インターポーザル
- ・ 擬似SOC
- ・ MDW3次元垂直型配線
- ・ 自己組織化高密度実装
- ・ 異種材料多層集積
- ・ ビルドアップ多層集積
- ・ チップレベル高精度接合
- ・ 低ストレスダイシング

表3 ファインMEMSとMemsONEとのカテゴリ関連マトリクス

大分類	MEMS/ONE分類 中分類	MEMS/ナノ機能複合技術				MEMS/半導体一体形成技術						MEMS/MEMS高集積化結合技術						
		ナノ 機械構造	選択的 バイオ修飾	選択的 材料修飾	ナノ機能 デバイス化	プロセス 統合モノ シリック	センサ 新原理	縦方向配線			横方向配線			異種 材料 多層 集積	ビルドアップ多層集積		低スト レスダ イシン グ	
								CMOS/ME MS多層	3次元インテ ーポーザル	接合 SOC	MD*3次元 垂直型配線	自己組織化 高密度実装	ビルドアップ 多層集積		チップレベル 高精度接合			
プロセス	成膜	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎								
	ドライエッチング	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎				◎				
	ウェットエッチング	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎								
	洗浄	◎	◎	◎	◎	◎		◎		◎								
	リソグラフィ	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎		◎				◎				
	接合													◎	◎		◎	
	不純物拡散・熱処理	◎		◎	◎	◎								◎	◎			
	パッケージ										◎			◎	◎			
	マルチプロセス					◎								◎	◎			
その他				◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				◎		
デバイス	制御	光制御	◎		◎	◎				◎				◎	◎		◎	
		電気制御	◎		◎													
	感知	流体制御																
		物理センシング	◎	◎			◎	◎	◎		◎			◎	◎			
	可動構造	化学バイオセンシング																
		静電駆動	◎		◎	◎	◎	◎	◎		◎			◎	◎		◎	
	固定構造	電磁駆動																
マイクログローブ		◎	◎	◎	◎	◎				◎			◎	◎				
マイクロニードル																		
材料	半導体材料					◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	酸化膜/窒化膜					◎				◎			◎	◎	◎	◎	◎	
	ポリマー									◎			◎	◎	◎	◎	◎	
	ガラス/セラミクス									◎			◎	◎	◎	◎	◎	
	磁性材料												◎	◎	◎	◎	◎	
	圧電材料									◎			◎	◎	◎	◎	◎	
	形状記憶合金																	
	その他												◎	◎	◎	◎	◎	
材料特性	基本特性	◎		◎	◎							◎	◎	◎	◎	◎	◎	
	力学特性	◎		◎	◎													
	熱特性	◎		◎	◎									◎	◎			
	電気特性		◎	◎	◎			◎	◎		◎							
	光学特性	◎	◎													◎		
	圧電特性							◎					◎	◎				
解析	応力-ひずみ解析				◎			◎						◎			◎	
	接合解析								◎					◎		◎	◎	
	プロセス解析																	
	半導体解析																	
	伝熱解析																	

(2) 知識データ収集用システムの構築

上述の「知識の体系化」の検討結果に基づき、知識データを格納するデータベース及び知識データの入力・表示方式の設計を行い、さらにデータの入力およびウェブを通じて広く公開する際に必要な機能について開発を行った。図6には、MMC内に構築した知識データ収集用システムの概要を示す。この収集システムは、2006年12月に運用を開始し、本事業参加メンバー（委託・助成事業者・再委託大学）がインターネット経由で、直接知識データを入力・参照することが可能となった。また、このシステムの改善については、ファインMEMS知識DB委員会活動(②-4 プロジェクトの推進並びに本開発事業の運営管理支援参照)を通じて、データ収集進捗管理、学会等の最新情報のデータベース化と並行して取り組んだ。

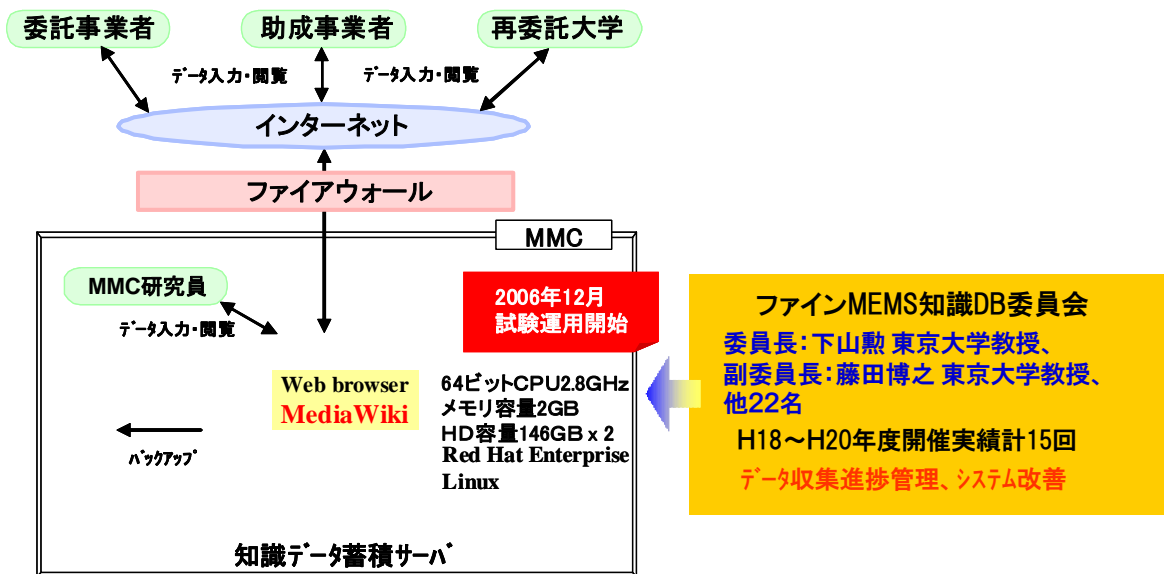


図6 知識データ収集用システムの概要

次に、知識データ収集用システムに実装した機能の概要を以下に示す。

図7-1にはシステムのメインページを示す。



図7-1 データベースメインページ画面

図7-2には、知識データ入力（新規事例入力）画面を示す。この画面では、事例タイトル、カテゴリ（表3）を選択し、知識データ（事例）タイトルを入力後、新規事例入力ボタンを押すことで、選択したカテゴリに対応する編集画面を表示させ、各種情報を入力・登録することができる。編集画面で入力したデータ例を図7-3に示す。

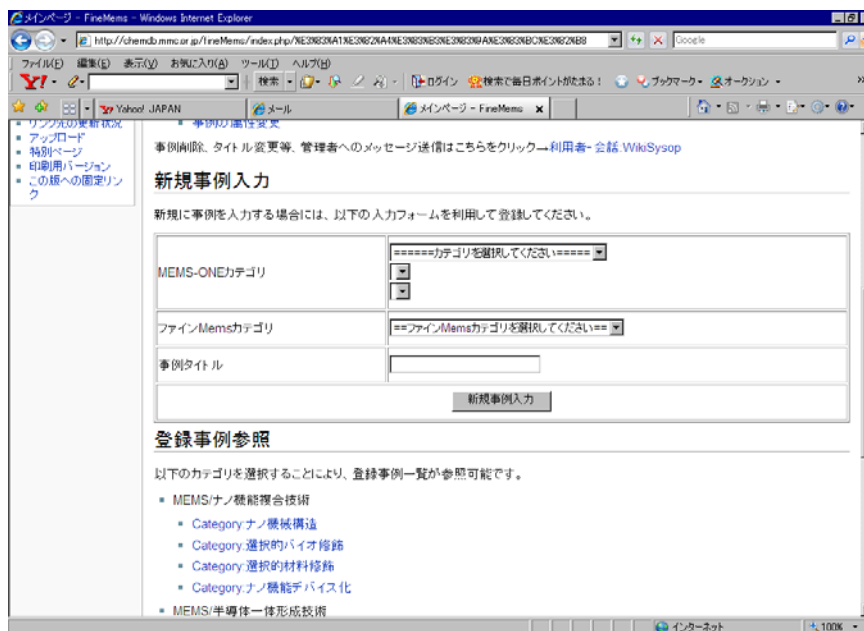


図7-2 知識データ入力画面



図7-3 編集画面で入力した知識データの例

また、このシステムでは、ファインMEMSカテゴリでのデータ集積状況およびMemsONEカテゴリ分類でのデータ集積状況を表示させる機能を実装した。図7-4には、ファインMEMSカテゴリ毎の登録数を表示した例を示し、図7-5には、MemsONEカテゴリ分類でのデータ集積状況を表示した例を示す。

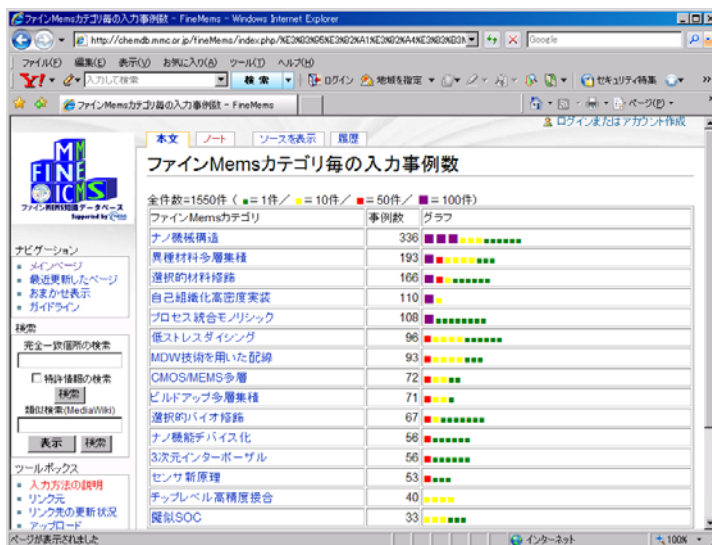


図7-4 ファインMEMSカテゴリ別の入力ランキング表示例



MemsONE 中分類カテゴリの入力ランキング表示へリンク

図7-5 MemsONEカテゴリ別の入力ランキング表示例

さらに、本システムでは、データベースの使い勝手を高めるために、日本語の検索精度を高めた検索ボックスを実装した。このボックスでは、登録データのタイトル、及び本文について検索ワードの完全一致部分を検索することができ、空白区切りでAND検索が可能である。さらにこの検索機能では、特許データベース対象・非対象を選択可能とし、特許データの全文検索結果を網羅することが可能である。図7-6に検索実行の表示例を示す。

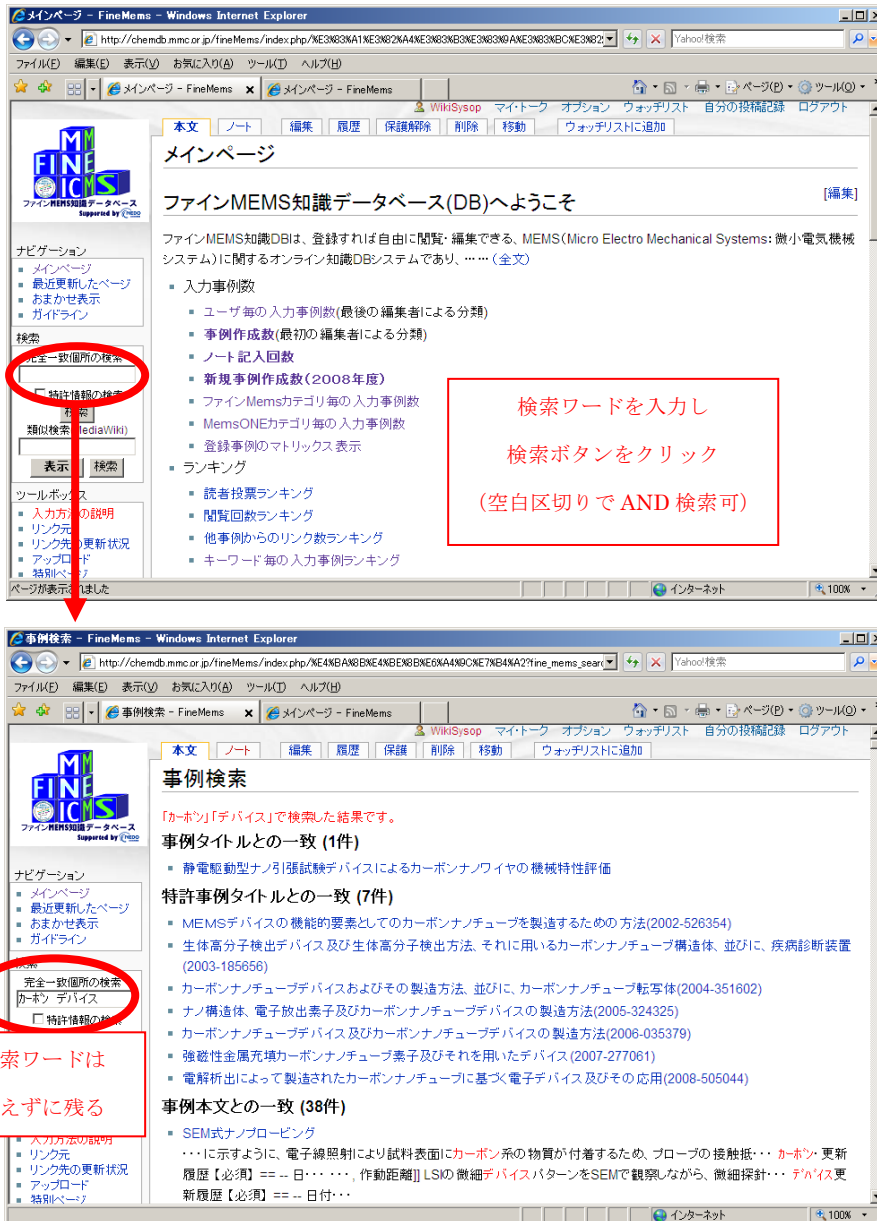
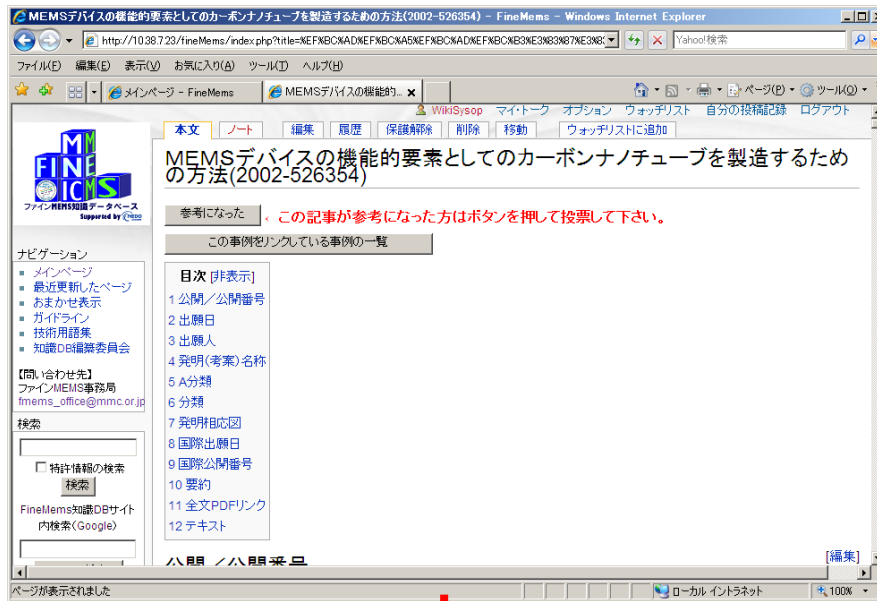


図 7-6 日本語検索実行の画面表示例

また、特許調査のデータベースは、図 7-1 のデータベースメイン画面の「特許調査」から、特許情報一覧の Web ページにリンクしており、公開年別一覧、分野別一覧、及び欧米特許分析資料集の閲覧を可能とした (図 4 参照)。図 7-7 には、特許データの登録例を示す。



スクロールして画面下方へ

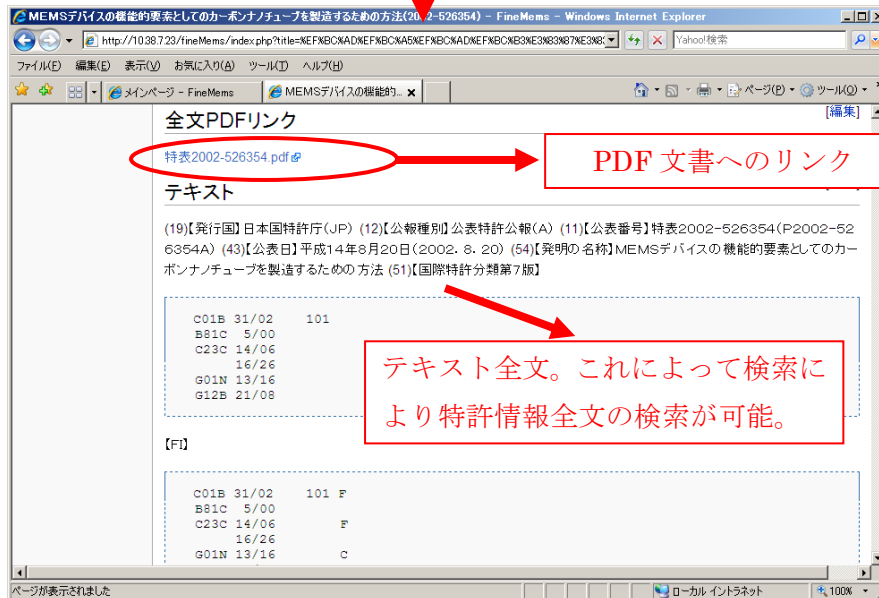


図 7-7 特許データの登録例

(3) Web上の一般公開に向けたガイドライン作成および一般公開用システムの構築と運用

データベースの著作権、個人情報保護等についての弁護士見解を踏まえ、公開用データベースに掲載する利用ガイドライン、利用規約を作成し（弁護士による条文精査も行き）、実装を行った。図 8-1 に実装する利用ガイドラインの画面表示、図 8-2 には利用規約の画面表示を示す。



図 8-1 公開用知識データベースに実装する利用ガイドラインの画面表示



図 8 - 2 公開用知識データベースに実装する利用規約の画面表示

次に、一般公開用メインページ（図8-3）と一般公開用システムの機能を以下に示す。



図8-3 公開用知識データベースのメインページ

一般公開用のデータベースでは、上述の利用規約・ガイドライン以外に、一般ユーザにとって有用な機能、表示として、MEMSに関する略語等の技術用語を閲覧・登録できる技術用語集の実装、グーグル検索ボックスの配置、ファインMEMS知識データベースの概要紹介の表示、新規登録事例の表示、お知らせの表示、ファインMEMSカテゴリ別のランキングの表示、ファイン知識DB委員会のメンバーが選んだキーワードによるランキングの表示等を追加した。さらに、一般ユーザがデータベースの閲覧・編集ユーザになるための登録機能を実装した。図8-4に技術用語集の表示画面を示し、図8-5には、ユーザ登録のアカウント名とパスワード作成画面（利用規約および利用ガイドラインの承認を求める画面構成）を示す。

また、一般公開用知識データベースの運用については、ファインMEMS知識DB委員会を通じて検討し、知識データ収集システムと同様に、プロジェクト終了後も継続してMMC内にサーバを置き、MMCが管理者となって、サーバの管理、データのバックアップ、著作権侵害等、法律に抵触する内容の監視、一般ユーザの登録アカウントの管理、各種問い合わせ対応等を行うことを決めた。

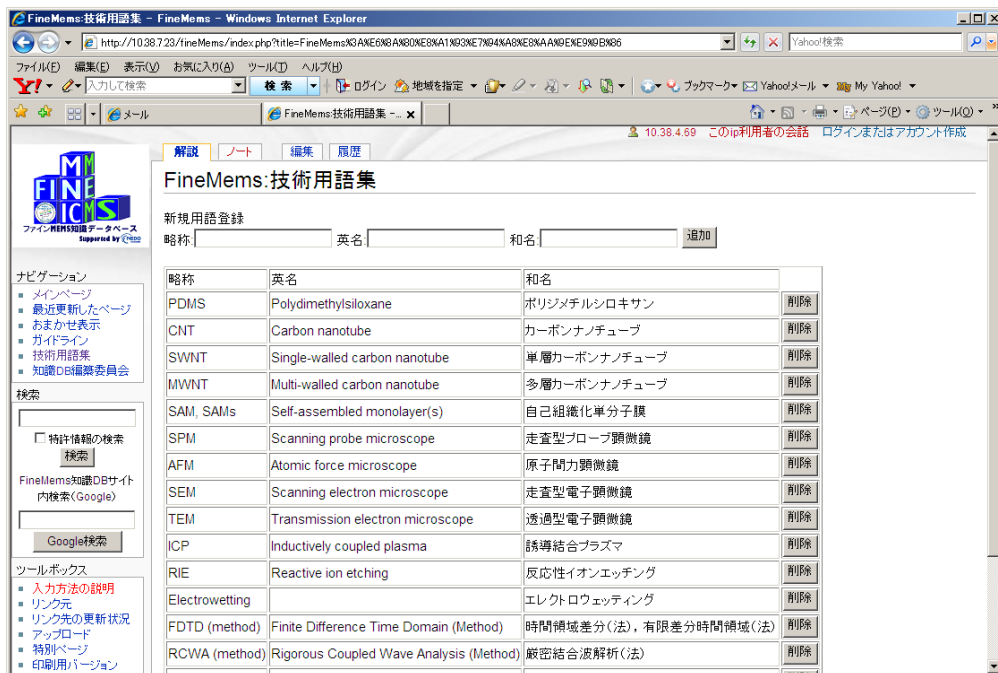


図 8 - 4 技術用語集の表示画面

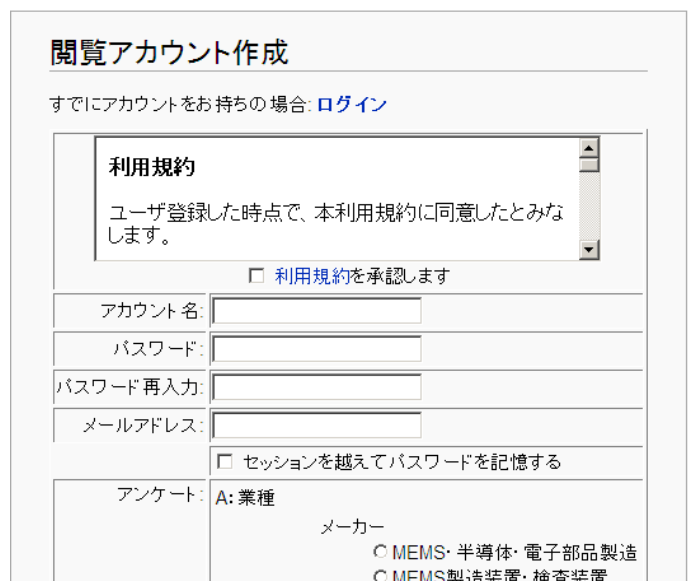


図 8 - 5 ユーザ登録のアカウント作成画面

(4) MemsONE 知識データベースへのデータ変換

データベースの表示ソフトウェア（ファインMEMS システム：MediaWiki、MemsONE システム：MemsONE 独自のソフトウェア）およびデータ入力形式が異なるため、データ変換ツールを作成し、ファインMEMS 知識データ（全 1557 件）の MemsONE 知識データへの変換を実施した。

MemsONE 知識データベースではデータの入力を XML 形式（Extensible Markup Language 形式）のデータファイルから入力することになっているため、その XML 形式のデータファイルにファイン MEMS の知識データを変換して入力する必要がある。以下に変換プロセスと図 9-1 にフローを示す。

① 変換スクリプトの作成

ファイン MEMS のテンプレートの項目に従って MemsONE 知識データベース入力用 XML ファイルを作成する変換スクリプトを作成した。（MemsONE 知識データベース入力用 XML ファイルを作成するため、ファイン MEMS 知識データベースでは知識データの入力用のテンプレートの項目を MemsONE 知識データベースの入力用 XML 形式の項目と一致させてある（図 9-2）。）

② MemsONE 入力用 XML ファイルの作成

作成したスクリプトを用いて、ファイン MEMS 知識データから MemsONE 知識データ入力用 XML ファイルを作成する。

③ MemsONE 知識データベースへの入力

MemsONE 知識データ入力用 XML ファイルを使って MemsONE 知識データベースへ知識データを入力する。

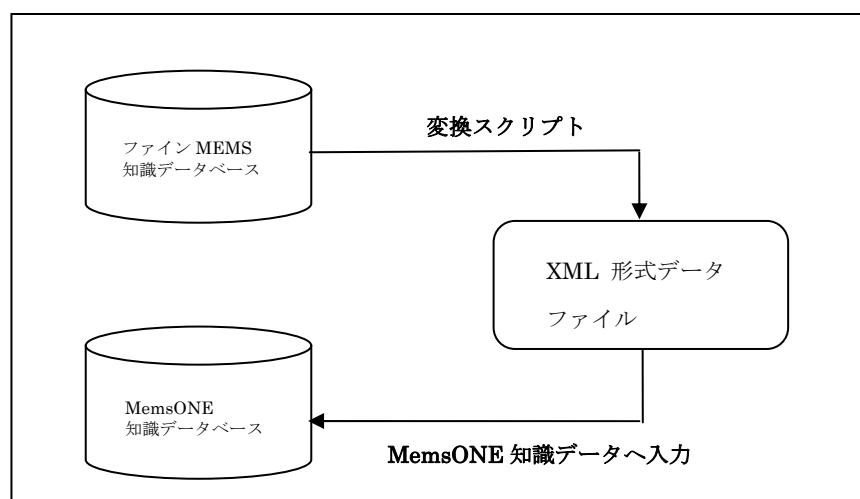


図 9-1 MemsONE 知識データベースへの変換

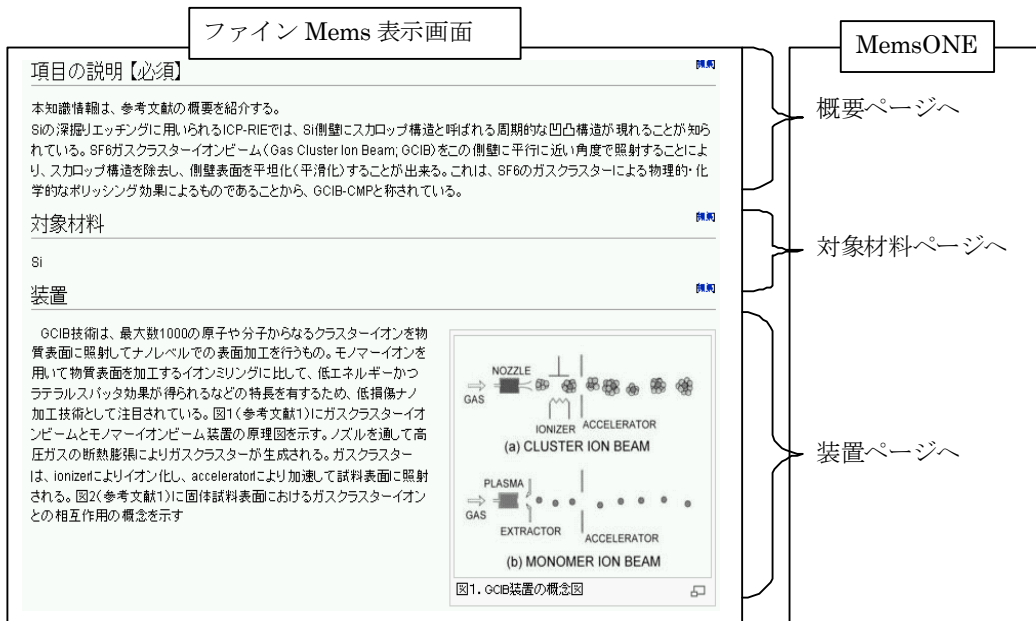


図 9-2 データ入力形式の違い

「X線二重露光法による PMMA 3次元加工技術」をサンプルとして MediaWiki を用いた Web ベースのファイン MEMS 知識データから MemsONE 知識データに変換した結果を図 9-3 に示す。

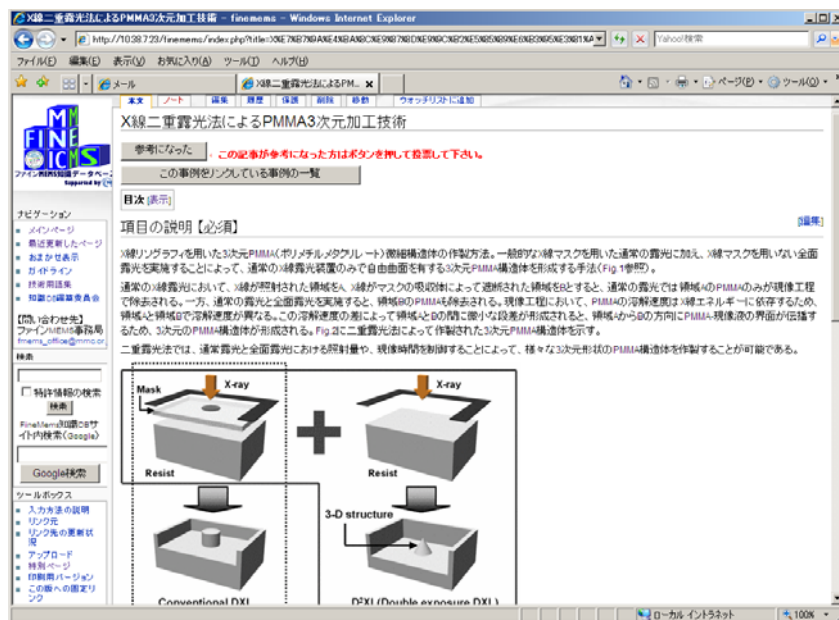


図 9-3 (a) ファイン MEMS 知識データベースの表示例

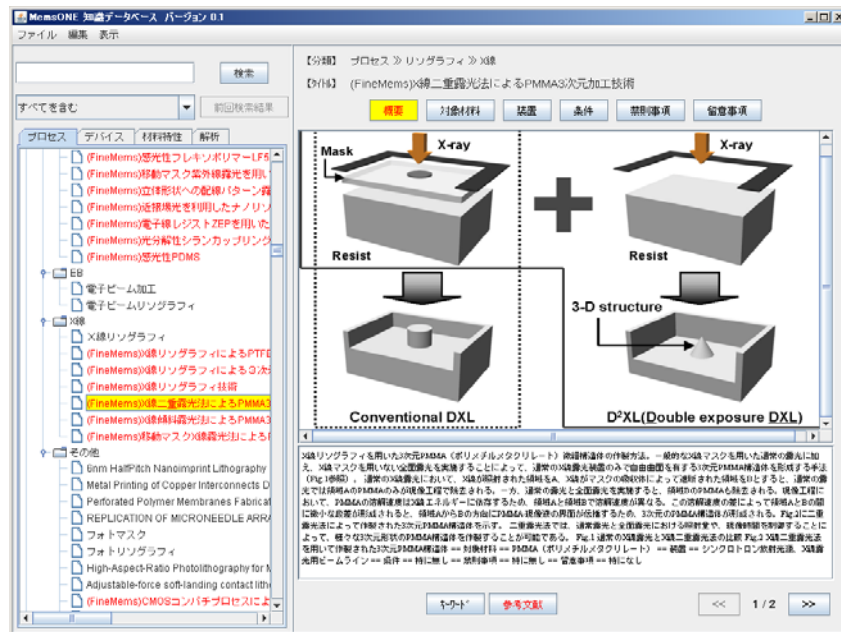


図 9 - 3 (b) MemS ONE 知識データベースへ変換後の表示例

②-4 プロジェクトの推進並びに本開発事業の運営管理支援

高集積・複合MEMS製造技術開発プロジェクトの参画事業者の研究者、再委託大学の研究者、および有識者から成る「高集積・複合MEMS知識データベース委員会（委員長 下山勲 東京大学教授、副委員長 藤田博之 東京大学教授、副委員長 三原孝士 オリンパス株式会社、副委員長 入江康郎 みずほ情報総研株式会社、委員 20名）」（以下「ファインMEMS知識DB委員会」という）を設置し、知識データの収集・整理、データベースシステムの仕様・機能、及び公開用データベースの運営方針・普及活動等について広範な検討を行った。平成18年度は、9月、12月、2月に計3回、平成19年度は、4月、6月、9月、10月、12月、2月に計6回、平成20年度も、前年と同様に、4月、6月、9月、11月、12月、3月に計6回開催した。また、本開発プロジェクトの参画事業者の研究開発責任者クラスから成る「ファインMEMSプロジェクト推進連絡会」（座長 下山勲 東京大学教授、副座長 杉山進 立命館大学教授、委員 15名（平成18年度）、16名（平成19～20年度））を設置し、研究項目別の進捗状況の把握、研究項目間の調整、研究開発成果の普及活動等に関わる運営支援をすることにより、本プロジェクト全体の円滑なる推進を図った。平成18年度は、7月、11月、2月の計3回、平成19年度は、6月、8月、11月、2月に計4、平成20年度は、5月、8月、12月、2月に4回開催した。

2-4. 開発成果のまとめ

(1) 目標の達成度

	目標	達成度	備考
基本計画目標	全研究開発項目に係わる知見のDB化	○	1500件超の知識データをDB化 特許情報4500件超をDB化
基本計画目標	MemsONE知識DBへの実装	○	全データをMemsONEデータとして統合
自主目標1	知識の体系化	○	ファインMEMS/MemsONE カテゴリの関連マトリックスを構築
自主目標2	知識データ収集用システム構築	○	Wikiベースの知識データ収集用システムを マイクロマシンセンターに構築
自主目標3	DB入力・表示機能開発	○	データ入力初期設定機能、各種ランキング ・新着知識表示、全文検索機能を実装
自主目標4	公開用DBシステムの構築	○	一般ユーザの利用規約、ユーザアカウント作成 機能等を実装し、マイクロマシンセンターに構築
自主目標5	MemsONEデータ入力形式に変換	○	変換スクリプトを作成し、全データをMemsONE データに変換

ファインMEMSプロジェクトの研究開発項目にかかわる研究成果（研究データ、科学的知見、および文献情報）を、三年間合計で1000件以上収集し、体系的にデータベース化するとともに、収集した知識データをMEMS用設計解析支援システム(MemsONE)の知識データベースに付加することを目標とした。本研究開発では、インターネットを通じて複数のユーザが自由記述・閲覧可能なWebブラウザ/MediaWikiシステムをデータ蓄積サーバ(MMC内)に実装し、さらに知識データの体系的格納を可能に、かつ支援できるデータベースのシステム、入力・表示・検索機能を開発することで、知識データの蓄積及びデータベースシステムの構築を行った。このシステムを用いて、ファインMEMSプロジェクトのカテゴリおよびMemsONEのカテゴリで分類し、目標をはるかに上回る1500件超の知識データをデータベース化することができた。また、ファインMEMSの知識データは、データ変換ツールの開発により、MemsONEシステムの知識データとして変換を完了した。

(2) 成果の意義

高集積・複合MEMS開発・製造を目指す研究者・技術者が、インターネットを介して自由にDBにアクセスでき、DBの可視化・検索機能の搭載により活用し易く、アプリケーションの知識がなくても知識データの更新が容易なDBシステムを実現した。

(3) 知的財産等の取得

なし。

(4) 成果の普及

①展示会による普及活動

第17回マイクロマシン展 (2006年11月7日～9日、東京国際フォーラム)

第18回マイクロマシン展 (2007年7月25日～27日、東京ビッグサイト)

国際ナノテクノロジー総合展 nano tech2008 (2008年2月13日～15日、東京ビッグサイト)

第19回マイクロマシン展 (2008年7月30日～8月1日、東京ビッグサイト)

第20回マイクロマシン展 (2009年7月29日～7月31日、東京ビッグサイト)

②ファイン MEMS プロジェクト成果発表会の開催 (2007年7月27日、2008年7月31日、2009年7月31日、東京ビッグサイト)

③ファイン MEMS ホームページによる広報活動

マイクロマシンセンターのホームページ内に開設した「ファイン MEMS」のホームページを漸次更新し、当プロジェクトの活動内容を一般公開した。

④知識データベースの一般公開

マイクロマシンセンターのホームページ内に開設した「MEMSPedia」のホームページに2009年6月第2週より知識データベースの一般公開を開始した。

3. 実用化・事業化の見通し

(1) 成果の実用化可能性



知識の集積化を継続し、MEMS分野の包括的な知識基盤となる百科事典“MEMSPedia”として整備予定

(2) 波及効果

知識データベースを整備することにより、今後成長が期待される自動車、情報通信、安全・安心、環境、医療等の分野において必要不可欠となる、小型・省電力・高性能・高信頼性の高集積・複合MEMSの製造技術に関する高度な知見やデータを容易に利用することが可能となり、様々なMEMSの創出、MEMS開発・製造効率の向上、さらにMEMS研究者・技術者の裾野拡大に寄与することが期待される。